

複合量子ビーム超高圧顕微解析研究室 装置利用料金表 (2025年7月1日改訂)

設備 equipment	型式 model number	一般利用 General use		マテリアル先端リサーチインフラ ARIM						オープンファシリティ Open Facility			
		学内利用 inside campus	学外利用 outside use	データ提供あり Data Provided			データ提供なし No Data Provided			学内利用 inside campus		学外利用 outside use (大学の機関)	学外利用 outside use (一般)
				学内利用 inside campus	学外利用 outside use (大学の機関)	学外利用 outside use (一般)	学内利用 inside campus	学外利用 outside use (大学の機関)	学外利用 outside use (一般)	部局内 Faculty of ENG	部局外 Outside the Faculty of ENG		
複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡(イオン加速器含む) Multi quantum beam High Voltage Electron Microscope	JEM-ARM-1300	¥4,000/h ¥30,000/d	¥10,000/h ¥80,000/d	¥3,400/h	¥3,900/h	¥5,300/h	¥4,400/h	¥5,100/h	¥6,800/h	¥4,700/h	¥4,800/h	¥7,600/h	¥9,900/h
収差補正走査透過型電子顕微鏡 Cs-corrected Scanning Transmission Electron Microscope	Titan G2	-	-	¥3,900/h	¥7,600/h	お問合せください	¥5,000/h	¥9,800/h	お問合せください	-	-	-	-
量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置 Microscopic measuring equipment for physical properties on quantum/electronic controlled nano-materials	NEOARM	-	-	¥3,400/h	¥4,800/h	¥11,700/h	¥4,300/h	¥6,100/h	¥15,000/h	¥4,700/h	¥4,800/h	¥16,700/h	¥21,700/h
電界放射型200kV透過型電子顕微鏡(FE-TEM) 200kV Field-Emission Transmission Electron Microscope	JEM-2010F	-	-	¥2,400/h	¥2,600/h	¥2,700/h	¥3,100/h	¥3,400/h	¥3,400/h	-	-	-	-
汎用200kV透過走査型電子顕微鏡(2100) 200kV Scanning Transmission Electron Microscope	JEM-2100	-	-	-	-	-	-	-	-	¥1,900/h	¥2,000/h	¥3,300/h	¥4,200/h
汎用200kV透過型電子顕微鏡(FX) 200kV Transmission Electron Microscope	JEM-2000FX	¥700/h ¥5,000/d	¥2,000/h ¥15,000/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電界放射型走査型電子顕微鏡(FE-SEM) Scanning Electron Microscope	JSM-7001FA	¥600/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集束イオンビーム加工観察装置 Focused Ion Beam	JEM-9320FIB	-	-	¥1,600/h	¥2,200/h	¥4,900/h	¥2,100/h	¥2,800/h	¥6,300/h	¥2,200/h	¥2,300/h	¥7,000/h	¥9,000/h
Arイオン研磨装置 Precision Ion Polishing System	PIPS	-	-	-	-	-	-	-	-	¥500/h	¥500/h	¥1,200/h	¥1,600/h

*FE-SEM(エネマテ共通機器)については稼働日数の30%を学内共同利用に供する

*各装置について利用料金の算定基準となる課金は30分単位で行う。(30分未満の利用時間は0分に、30分以上の利用時間は30分に、それぞれ切り捨てて課金を行う。)